

05:07:11:12

©1994

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СИЛЫ
ОСЦИЛЛЯТОРА ОПТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА
ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В ТОНКИХ
ПЛЕНКАХ WO_3**

А.И.Гаврилюк, Г.М.Гусинский, Т.Г.Ланская

В настоящее время интенсивно изучаются механизм образования и природа центров окраски (ЦО), возникающих в тонких пленках WO_3 при инжекции водородных атомов.

Инжекция водорода в тонкие пленки WO_3 может осуществляться двумя способами:

- 1) катодной поляризацией пленок WO_3 в растворах протонных электролитов [1];
- 2) фотостимулированным отщеплением водородных атомов от водородосодержащих молекул, предварительно адсорбированных на поверхности пленок WO_3 [2].

Одним из важнейших параметров ЦО, образующихся в WO_3 при инжекции водородных атомов, является величина силы осциллятора оптического перехода f . Величина f обычно определяется с помощью формулы Смакулы [3]

$$N \cdot f = 8.7 \cdot 10^{16} \frac{n}{(n+2)^2} \alpha_{\max} \Delta U_{0.5}, \quad (1)$$

где N — концентрация ЦО, см^{-3} ; n — показатель преломления пленок WO_3 ; α_{\max} — коэффициент поглощения в максимуме полосы ЦО, см^{-1} ; $\Delta U_{0.5}$ — полуширина полосы поглощения, эВ; f — сила осциллятора оптического перехода. Величина показателя преломления n для пленок WO_3 известна. Величины α_{\max} и $\Delta U_{0.5}$ могут быть получены из измерений спектров пропускания пленок. Если пренебречь отражением на границах пленка–воздух и пленка–подложка, то

$$\alpha = 2.3 \frac{D}{d}, \quad (2)$$

где D — оптическая плотность пленок; d — толщина пленок, см. Оптическая плотность

$$D = 1g \frac{1}{T} \quad (3)$$

(где T — пропускание пленок) определяется непосредственно из оптических измерений.

Таким образом, для вычисления величины силы осциллятора f из формулы Смакулы, помимо проведения оптических измерений, необходимо с помощью независимой методики определить концентрацию N инжектированных ЦО. Ранее для этой цели использовались две методики. По первой из них инжекция водорода проводилась катодной поляризацией пленок WO_3 в растворе протонного электролита [4,5]. При этом измерялась величина электрического заряда и считалось, что весь этот заряд тратится только на образование ЦО. Это давало основание связать величину измеряемого заряда с концентрацией ЦО.

По второй методике инжекция водородных атомов осуществлялась с помощью их фотостимулированного отщепления от молекул органических соединений, адсорбированных на поверхности WO_3 [6]. Концентрация ЦО определялась по величине сигнала ЭПР и из измерений статической магнитной восприимчивости. При этом считалось, что все инжектированные в WO_3 ЦО являлись парамагнитными.

Обе методики не свободны от недостатков. При использовании первой из них нет достаточных оснований считать, что весь электрический заряд тратится только на инжекцию атомов водорода в WO_3 . Существует большая вероятность протекания и других процессов в электролитической ячейке. В этом случае значение концентрации инжектированных ЦО (или водородных атомов) может оказаться завышенной, что в свою очередь приведет к занижению величины силы осциллятора f , определенной из формулы Смакулы.

В то же время хорошо известно, что в WO_3 далеко не все ЦО являются парамагнитными. В ряде случаев наблюдается спаривание состояний W^{5+} и образование диамагнитных биполяронов [7]. Поэтому заниженное значение концентрации ЦО, полученное из данных ЭПР, может привести к завышению величины f .

Поэтому в данной работе была предложена и использована новая методика определения величины силы осциллятора оптического перехода. Для этой цели использовалась пленочная гетероструктура, изображенная на рис. 1. Технология изготовления подобных пленочных структур подробно описана в [8]. Сразу после изготовления пленочная гетероструктура помещалась в герметичную кювету с кварцевым окном. Кювета откачивалась до давления $\sim 10^{-2}$ мм рт.ст., после чего в нее напускались пары дейтерированного метанола CD_3OD . Давление паров составляло 30 мм рт.ст.

УФ-свет

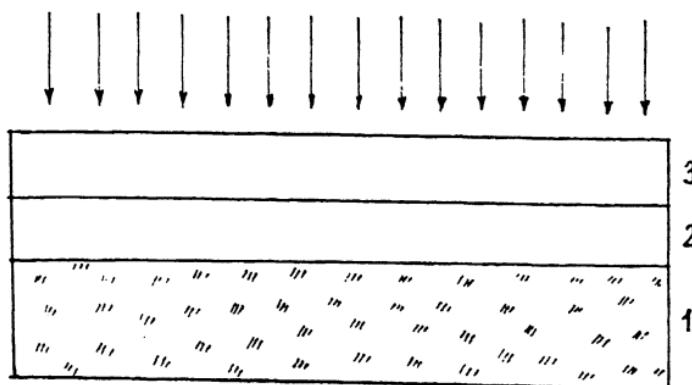


Рис. 1. Пленочная гетероструктура для определения силы осциллятора оптического перехода ЦО в поликристаллических пленках WO₃. 1 — кварцевая подложка, 2 — поликристаллическая пленка WO₃ толщиной $d = 1.0$ мкм, 3 — аморфная пленка WO₃ толщиной $d = 0.6$ мкм.

Затем через кварцевое окно проводилось облучение гетероструктуры нефильтрованным светом ртутной лампы ПРК-4 мощностью 250 Вт.

Как известно из [^{2,8}], при этом происходит инжекция водородных атомов, отщепленных от молекул метанола, в аморфную пленку WO₃. Затем водородные атомы мигрируют через аморфный слой в поликристаллическую пленку WO₃, изменяя ее оптические и электрические параметры.

После проведения облучения пленочная гетероструктура вынималась из кюветы и аморфная пленка WO₃ стравливалась в течение нескольких секунд в 1%-м водном растворе щелочи. После этого проводилось измерение спектра пропускания поликристаллической пленки WO₃ и осуществлялся анализ микроколичеств инжектированного в пленку водорода. Измерение спектра пропускания проводилось в вакуумной кювете для того, чтобы избежать окисления инжектированного в WO₃ водорода кислородом воздуха, а также чтобы избежать нежелательного изотопного обмена между инжектированным в WO₃ дейтерием и протонами молекул атмосферной влаги в случае нахождения на воздухе.

Анализ микроколичеств инжектированного водорода осуществлялся с помощью ядерной реакции $^2\text{D}(\text{He}, p)\alpha$, проведенной на циклотроне ФТИ им. А.Ф. Иоффе и подробно описанной в [^{9,10}]. Поскольку анализ микроколичеств водорода проводился по его изотопу — дейтерию, — то облучение гетероструктуры проводилось в парах дейтерированного метанола CD₃OD. Проведение анализа по дейтерию дает возможность “отстроиться” от адсорбционного фона, который присутствует при использовании основного изото-

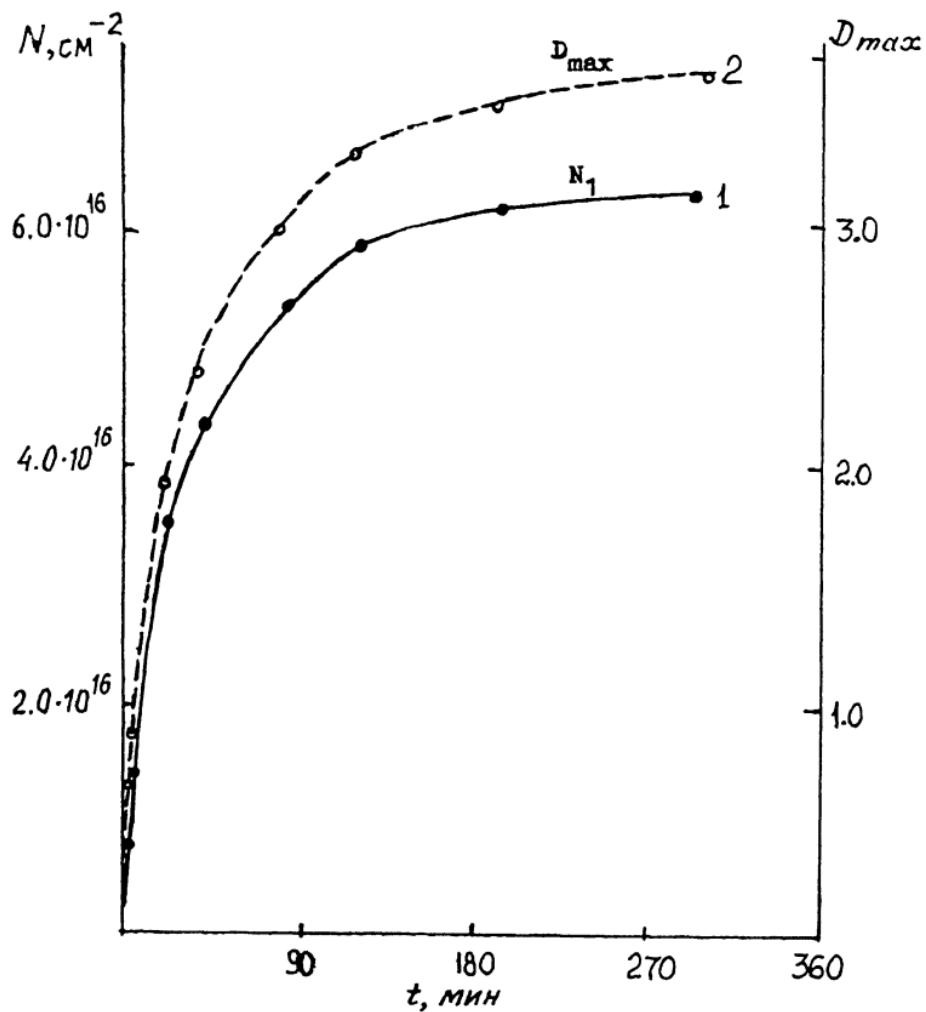


Рис. 2. Зависимости содержаниядейтерия N_1 (кривая 1) и оптической плотности D_{\max} (кривая 2) в максимуме фотоиндуцированной полосы поглощения при $E = 0.69$ эВ и $\lambda = 1.8$ мкм от времени облучения t пленочной гетероструктуры в парах дейтерированного метанола CD_3OD . Параметры N_1 и D_{\max} определены после стравливания аморфной пленки WO_3 .

па вследствие адсорбции на поверхности оксида молекул воды и органических загрязнений. Известно, что поликристаллические пленки WO_3 гетероструктуры, изображенной на рис. 1, обладают малой удельной поверхностью и в силу этого малой адсорбционной способностью по отношению к таким достаточно большим молекулам, как молекула метанола [2,8,9]. Это и обусловливает их практическую нечувствительность к световому облучению в присутствии паров метанола. Все вышесказанное дает основание считать, что увеличение содержания дейтерия в поликристаллических

пленках WO_3 при облучении гетероструктуры УФ светом связано с инжекцией водорода, отщепленного от молекул метанола, адсорбированных на поверхности аморфных пленок WO_3 . Это подтверждает рис. 2, из которого видно, что зависимости содержания дейтерия N_1 в поликристаллических пленках WO_3 и оптической плотности D_{\max} в максимуме фотоиндуцированной полосы поглощения от времени облучения t имеют одинаковый характер. Если подставить выражение (2) в формулу Смакулы (1), то можно легко получить выражение определения величины силы осциллятора оптического перехода для ЦО в поликристаллических пленках WO_3 :

$$f = 8.7 \cdot 10^{16} \frac{n}{N_1(n^2 + 2)^2} \cdot 2.3 D_{\max} \Delta U_{0.5}, \quad (4)$$

$$N_1 = N \cdot d, \quad (5)$$

где N_1 — содержание дейтерия, см^{-2} .

Как известно, полуширина полосы поглощения для поликристаллических пленок WO_3 составляет $\Delta U_{0.5} = 0.8 \text{ эВ}$, а величина показателя преломления $n = 2.5$ [2]. Подставив эти значения в выражение (4), а также данные, приведенные на рис. 2, можно вычислить величину силы осциллятора, которая составляет $f = 0.35$. Этот результат отличается как от величины $f = 0.1$, полученной путем измерения заряда в электролитической ячейке [4,5], так и от величины $f = 0.7$, полученной по данным ЭПР [6]. Причины различия обсуждались выше.

В заключение авторы выражают благодарность Ф.А. Чудновскому за поддержку и интерес к работе.

Список литературы

- [1] Фаунен Б.В., Крэнделл Р.С. Дисплеи. М.: Мир, 1982. С. 228–266.
- [2] Гаврилюк А.И., Секущин Н.А. Электрохромизм и фотохромизм в оксидах вольфрама и молибдена. Л.: Наука, 1990. 104 с.
- [3] Dexter D.L. // Sol. State Phys. 1958. V. 6. P. 370–385.
- [4] Faughnan B.W., Grandall R.S., Heyman R.H. // RCA Revue. 1975. V. 36. N 1. P. 177–197.
- [5] Schirmer O.F., Wittwer V., Baur G., Brandt G. // J. Electrochem. Soc.: Solid-State Science and Tech. 1977. V. 124. N 5. P. 749–753.
- [6] Цикмач П.Д. Автореф. канд. дис. Рига, 1985. 16 с.
- [7] Schirmer O.F., Salje E. // J. Physics C. 1980. V. 13. N 36. L. 1067–1072.

- [8] Гаврилюк А.И., Ланская Т.Г., Чудновский Ф.А. // ЖТФ. 1987. Т. 57. В. 8. С. 1617–1622.
- [9] Гаврилюк А.И., Гусинский Г.М., Мансуров А.А., Рассадин Л.А., Чудновский Ф.А. // ФТТ. 1986. Т. 28. В. 7. С. 2053–2056.
- [10] Ланская Т.Г. Автореф. канд. дис. Л., 1991. 211 с.

Физико-технический
институт им.А.Ф.Иоффе
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
4 февраля 1994 г.
